

セルミックマイクロスコープシリーズ

SE-CDM

段差測定デジタルマイクロスコープ

新製品

測

—はかる—

非接触でターゲットの段差を
PCに映し出す、
パワフルなデジタルマイクロスコープ。



*PC画面はイメージです

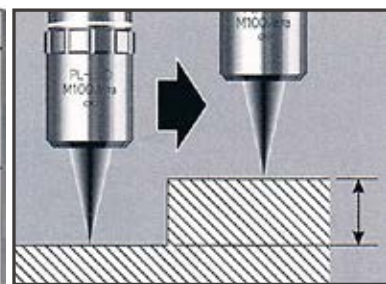
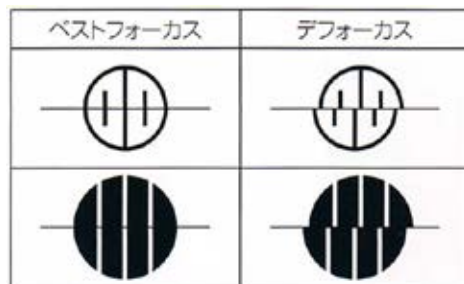
セルミックのマイクロスコープに光学式焦点位置検出方式の非接触段差測定機が加わりました。
パソコンにターゲット像を映し出し、測定点の表面状態を観察しながら、
高さ・深さ・段差等の測定が可能です。

SELMIC

新製品



※セットイメージ PC画面はハメコミ合成です。



焦点合わせは、被検面のピントを合わせるのではなく、ターゲット像の縦線が中央で左右にズれているか、正しく直線に見られるかを判断することによって測定します。

光学式焦点位置検出方式で、パソコンに映し出ししながら、非接触で段差を測定できる段差測定デジタルマイクロスコープです。プリサイズフォーカスユニットの採用により、ターゲット像を合わせるだけで、測定点の表面状態を観察しながら、高さ・深さ・段差等の測定が可能です。変形や打痕の心配が無いので、IC等の電子部品や精密加工部品の測定に最適です。

仕様

		DH2				
鏡体・ ブラケット	上下動範囲	粗動 140mm、微動 25mm				
	観察可能最大高さ	150mm				
	照明系	落射	ターゲットマーク入り照明、無段階ボリューム調光、LED照明 3W			
		透過	テレセントリック照明、可変開口絞り、無段階ボリューム調光、LED照明 3W			
	Z軸測定範囲	10mm				
Z軸測定精度	Range $\leq 1\mu\text{m}$ (0~10mm移動型) Range $\leq 2\mu\text{m}$ (0~25mm移動型) ※弊社標準測定方法による					
鏡筒	正立三眼	傾斜角 30°、正立像、眼幅調整範囲 54~75mm				
対物レンズ	PLLWDM40X	N.A. 0.50 W.D. 10.0mm				
接眼レンズ	NWF10X	倍率 10X、視野数 16、偏芯実線クロスレチクル入り				
ステージ	載物面の大きさ	*1 505S	505L	510D	*1 100D	150D
	ステージガラスの大きさ	$\phi 118\text{mm}$	$\phi 170\text{mm}$	280×190mm	$\phi 206\text{mm}$	$\phi 260\text{mm}$
	移動量 (X-Y)	50×50mm	50×50mm	170×120mm (100×50mm リニアスケール付)	$\phi 179\text{mm}$ (100×100mm リニアスケール付)	$\phi 250\text{mm}$ (150×150mm リニアスケール付)
	測定精度 (ステージ送り精度)	X: (4+0.02L) μm Y: (4+0.02L) μm L: 測定長 (mm)				
	回転角	360°	360°	*2	360°	360°
	ステージの大きさ	150×150×45mm	205×205×95mm	285×205×95mm	244×244×83mm	286×286×88mm

※1: ステージプレートが必要になります。 ※2: 510-RS 回転テーブル取付可

商品に関するお問い合わせは下記までご連絡ください

経営革新計画認証企業/事業可能性評価「めきき・しが」Aランク企業

株式会社セルミック

〒525-0032 滋賀県草津市大路 1-1-1 エルティくさつ 4階

TEL .077-516-4755 FAX .077-516-4756

E-mail info@selmic.co.jp

<http://www.selmic.co.jp/>

※商品に関する外観、仕様その他記載内容は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

